

В.Л. ДЯТЛОВ, С.К. ДЕМЕНТЬЕВ

О КОНСТРУКЦИИ И РАСЧЕТЕ ПАРАМЕТРОНА НА МАГНИТНОЙ
ПЛЕНКЕ

О конструкции пленочного параметрона

Сущность предлагаемой конструкции можно уяснить из рис. I, на котором показаны две проекции параметрона. Рассматриваемая конструкция состоит из подложки (5), удлиненной вдоль оси Y , на которой имеются два контакта (4). На одной стороне подложки снизу напыляется пермаллоевая пленка (1) и проводящая пленка (2), соединяющая контакты. С другой стороны подложки напыляется конденсатор параметрона, состоящий из двух проводящих (2) и одной диэлектрической (3) пленок.

Система пленок вместе с контактами образует колебательный контур, состоящий из пленочного конденсатора и индуктивности, величина которой определяется свойствами и размерами пермаллоевой пленки и размерами подложки.

В рассматриваемой конструкции не предусмотрено каких-либо проводников и контактов для создания возбуждающих переменного и постоянного магнитных полей в пермаллоевой пленке. Предполагается, что каждый параметрон располагается в некоторой полости, в которой создаются указанные поля, которые проникают в пермаллоевую пленку через проводящие пленки. Эти поля прикладываются вдоль оси Y параметрона. Предполагается также, что ось легкого намагничивания пермаллоевой пленки создается вдоль оси Y в процессе напыления.

2. Основные расчетные соотношения

Основные расчетные соотношения устанавливаются решением уравнений, описывающих параметрические колебания в пленочном параметроне. Эти уравнения получены в статье I:

$$n^2 \frac{d^2 \varphi}{d\theta^2} + \lambda \frac{d\varphi}{d\theta} + \frac{1}{2} \sin 2\varphi + (h_0 + h \sin 2\theta) \sin \varphi - h_x \cos \varphi = 0;$$

$$K_0 h_x + K_1 \frac{dh_x}{d\theta} + K_2 \frac{d^2 h_x}{d\theta^2} =$$

(2)

где

$$n^2 = \frac{\gamma \omega^2}{\mu_0 M H_K} = \frac{(1 + \mathcal{L}^2) \omega^2}{\mu_0^2 \gamma^2 H_K M};$$

$$\lambda = \frac{\mathcal{L} \omega}{\mu_0 \gamma H_K}; \quad h_0 = \frac{H_0}{H_K}; \quad h = \frac{H}{H_K};$$

$$K_0 = 1 + \frac{\gamma'}{\gamma};$$

$$K_1 = \frac{P \mu_0 S' \omega}{\gamma} + C \gamma' \omega;$$

$$K_2 = P \mu_0 S'' C \omega^2;$$

$$K_3 = \frac{P \mu_0 S' C \omega^2 M}{H_K};$$

$$K_4 = \frac{P \mu_0 S' \omega M}{\gamma \cdot H_K}.$$

Здесь ω - круговая частота параметрических колебаний,
 $\theta = \omega t$,

где t - время;

$\mathcal{L}$ - коэффициент релаксации в уравнении Ландау-Лифшица-Гильберта,

$$\mu_0 \gamma = 22,2 \cdot 10^6 \text{ см} \cdot \text{а}^{-1} \text{ сек}^{-1};$$

M - модуль магнитного момента;

H_K - коэрцитивная сила вращения;

H_0 - величина постоянного поля, направленного вдоль оси легкого намагничивания;

S' - площадь поперечного сечения пермаллоевой пленки (по оси y);

S'' - площадь поперечного сечения промежутка между пер-

маллоевой пленкой и обкладками конденсатора (по оси y);

C - емкость пленочного конденсатора;

γ - эквивалентное диэлектрическим потерям сопротивление пленочного конденсатора;

γ' - сопротивление проводящих пленок контура.

Если a - толщина, b - длина пермаллоевой пленки (вдоль оси y), то $S' = ab$.

Если a'' - толщина подложки, b'' - ее длина, то $S'' = a''b''$.

Величина емкости C может быть подсчитана из соотношения:

$$C = \frac{\epsilon_1 \epsilon_0 b' c}{a'},$$

где a' - толщина диэлектрической пленки конденсатора;

b' - длина перекрытия пленочных обкладок конденсатора;

c - ширина пленочных обкладок;

ϵ_1 - действительная составляющая комплексной проницаемости диэлектрической пленки на частоте $f = \frac{\omega}{2\pi}$.

Величина сопротивления γ может быть подсчитана из соотношения:

$$\gamma = \frac{a'}{\omega \epsilon_2 \epsilon_0 b' c},$$

где ϵ_2 - мнимая составляющая комплексной проницаемости диэлектрической пленки на частоте $\frac{\omega}{2\pi}$.

Коэффициент P для рассматриваемой конструкции параметрона можно определить, исходя из условия, что $c \gg a$, где c - ширина пленочного полувитка индуктивности и одновременно ширина пленочных обкладок конденсатора, а a - расстояние между проводящими пленками конденсатора и полувитком. При этом условии

$$H_x = \frac{1}{c} i \quad \text{и} \quad P = \frac{1}{c}.$$

Сопротивление γ' можно оценить по формуле:

$$\gamma' \approx \frac{2b'}{6c \cdot a''},$$

где a'' - толщина проводящих пленок контура,

b' - проводимость этих пленок.

Потери энергии в параметроне характеризуют три параметра: λ , γ и γ' . Параметр λ характеризует потери энергии в пермаллоевой пленке, γ' - потери в проводящих пленках, γ - потери в диэлектрике конденсатора. Эти потери будут отсутствовать при $\lambda \rightarrow 0$, $\gamma \rightarrow \infty$, $\gamma' \rightarrow 0$.

Если, изменяя свойства диэлектрика конденсатора и изменяя толщины проводящих пленок, сопротивления τ и τ' можно изменять так, чтобы они не оказывали существенного влияния на работу параметрона, то параметр λ зависит от физических свойств пленки, и его величина получается довольно определенной при каждой данной частоте колебаний магнитного момента пленки.

Согласно экспериментальным результатам [3], для пермаллоевых пленок 80% Ni, 20% Fe

$$\mathcal{L} \approx 0,011 + \frac{26 \cdot 10^6}{\omega}$$

Отсюда

$$\lambda = \frac{\mathcal{L}\omega}{\mu_0 \gamma H_K} \approx \frac{1,2}{H_K}$$

при $\omega \leq 2\pi \cdot 50 \cdot 10^6 \text{ сек}^{-1}$.

Условия, при которых можно пренебрегать потерями в сопротивлениях τ' и τ относительно колебаний с частотой $\frac{\omega}{2\pi}$, можно получить из уравнения (2):

$$K_1 \ll |K_0 - K_1|, \\ K_4 \ll |K_3|,$$

откуда следует, что $C\omega\tau' \ll 1 - \rho\mu_0\sigma''C\omega^2$ и $C\omega\tau \gg 1$. (3)

Однако имеется вполне определенный предел для уменьшения сопротивления τ' за счет увеличения размера a''' . В предлагаемых конструкциях параметронов пермаллоевая пленка экранирована проводящими пленками, и для проникновения поля в пермаллоевую пленку без амплитудных и фазовых искажений должно соблюдаться неравенство:

$$a''' \ll z_0 = \sqrt{\frac{2}{\omega\mu_0\sigma}}, \quad (4)$$

где z_0 - глубина проникновения поля в среду с такими же электромагнитными параметрами, как и у проводящих пленок.

1) Условие (4) обеспечивает как малые амплитудные искажения, так и малые фазовые искажения поля, проникающего в пермаллоевую пленку через неферромагнитные проводящие пленки, так как при проникновении поля в металлы действительная и мнимая составляющие постоянной распространения равны.

$$\begin{aligned} \text{Если принять } \sigma' &\approx 10^5 \text{ ом}^{-1} \text{ см}^{-1}, \\ \omega &= 2\pi \cdot 30 \cdot 10^6 \text{ сек}^{-1}, \\ \text{то } z_0 &= 2 \cdot 10^{-3} \text{ см.} \end{aligned}$$

При выполнении условий (3) уравнение (2) будет иметь вид:

$$h_x + K_2 \frac{d^2 h_x}{d\theta^2} = -K_3 \frac{d^2}{d\theta^2} \sin\varphi. \quad (5)$$

Из этого уравнения можно приближенно получить выражение для h_x , полагая $h_x \approx h'_x \sin\theta$:

$$h_x \approx -\nu^2 \frac{d^2}{d\theta^2} \sin\varphi, \quad (6)$$

$$\text{где } \nu^2 = \frac{K_3}{1 - K_2}.$$

Подставляя выражение для h_x из (6) в (1), можно получить такое уравнение:

$$\begin{aligned} n^2 \frac{d^2 \varphi}{d\theta^2} + \nu^2 \cos\varphi \frac{d^2}{d\theta^2} \sin\varphi + \lambda \frac{d\varphi}{d\theta} + \\ + \frac{1}{2} \sin 2\varphi + (h_0 + h \sin 2\theta) \cdot \cos\varphi = 0. \quad (7) \end{aligned}$$

Это уравнение было решено на электронной вычислительной машине при различных значениях ν , λ и h и при $n = 0,1$ и $h_0 = 1$ ($H_0 = H_K$). Результаты этих решений приведены в статье 3.

Из результатов решений следует, что наиболее стабильные параметрические колебания получаются при $\nu \approx 0,95$ при $\lambda = 1 + 0,5$, когда амплитуда колебаний $\varphi_m \approx 0,8$ и при $\nu \approx 0,9$, $\lambda \approx 0,5$, когда амплитуда колебаний $\varphi_m \approx 0,3$. Отсюда и из выражений для ν^2 , K_2 и K_3 , а также из других, приведенных выше соотношений, следует, что

$$\nu^2 = \frac{CL\omega^2}{1 - CL'\omega^2} \approx 0,9 \div 0,8,$$

$$\text{где } C = \frac{\epsilon_1 \epsilon_0 b' c}{a'},$$

$$L = \frac{\mu_0 \mu a b}{c},$$

$$\mu = \frac{M}{H_K}, \quad L' = \frac{\mu_0 a'' b''}{c}.$$

Напряжение на клеммах параметрона, которое совпадает с напряжением на емкости параметрона в рассматриваемой конструк-

ции при сделанных выше допущениях, можно выразить формулой:

$$u = ab \frac{dV}{dt} = \mu_0 M a b \omega \frac{d}{dt} \sin \varphi.$$

При малых углах отклонений φ_m вектора намагниченности максимальное значение напряжения гармоник частоты $\frac{\omega}{2\pi}$ можно определить по формуле

$$u_m \approx \mu_0 a b \omega M \varphi_m. \quad (9)$$

В обе расчетные формулы (8) и (9) не входит размер c . Это позволяет уменьшать этот размер до минимально возможного, тем самым уменьшая габариты параметрона, не изменяя, как следует из формулы (9), выходного напряжения. Однако при этом следует иметь в виду, что с уменьшением размера c будет как бы увеличиваться величина H_K на величину порядка $M \frac{a}{c}$ (если считать $c \ll b$). Действительно, при $c \ll b$ можно вычислить размагничивающий фактор для оси x магнитной пленки по формуле [2]:

$$N_x \approx \frac{abc}{16} \int_0^\infty \frac{ds}{(s + \frac{b^2}{4}) \sqrt{(s + \frac{a^2}{4})(s + \frac{c^2}{4})}} \approx \\ \approx \frac{ac}{8} \int_0^\infty \frac{ds}{(s + \frac{b^2}{4}) \sqrt{(s + \frac{a^2}{4})(s + \frac{c^2}{4})}} = \frac{ac}{c^2 - a^2} \left[1 - \frac{a}{c} \right] \approx \frac{a}{c}.$$

Отсюда и получается указанная выше добавка к величине H_K , равная $N_x M = \frac{a}{c} M$. Например, при $c \approx 2 \cdot 10^{-1}$ см. и $a \approx 2 \cdot 10^{-5}$ см. она равна $0,6 a \text{ см}^{-1}$. При значениях a , соизмеримых со значениями b , эта добавка будет меньшей.

В схеме для экономии места параметрона необходимо располагать достаточно близко друг к другу. Поэтому необходимо оценить поле около магнитных пленок отдельных параметронов. Оценку, например, можно провести при условии $c \ll b$. Поле можно определить в точках оси x вблизи пленки, исходя из величины магнитных зарядов на торцах пленок, которые равны $q = \pm ab M_x$. Эти заряды сосредоточиваются на торцах пленки вдоль размера b . На расстояниях, соизмеримых с размером c , при условии $c \ll b$ поле на оси x можно определить, используя теорему Остроградского-Гаусса:

$$H = \frac{a M_x}{2\pi x_1} - \frac{a M_x}{2\pi x_2},$$

где x_1 - расстояние от правого торца до рассматриваемой точки

и $x_2 = x_1 + c$ - расстояние от левого торца до рассматриваемой точки (рис.1).

При $x_1 = c = 2 \cdot 10^{-1}$ см.

$$H \approx \frac{10^{-5} \cdot 10^4}{4\pi \cdot 2 \cdot 10^{-1}} \approx 0,5 \cdot 10^{-1} a/\text{см}.$$

Этот расчет показывает, что при расположении соседних параметронов на расстояниях порядка c , взаимное магнитное влияние параметронов будет достаточно мало.

Мощность, выделяющаяся в параметроне, можно определить с помощью формулы, полученной в статье I:

$$\rho = \omega \mu_0 M H_K \lambda \frac{\varphi_m^2}{2},$$

где ρ - мощность, выделяющаяся в единице объема магнитной пленки при непрерывной работе параметрона.

Чтобы получить мощность, выделяющуюся в параметроне при трехтактной системе питания, надо умножить величину ρ на объем пленки и разделить ее на величину, равную приблизительно 3. Тогда

$$\rho = \frac{\rho a b c}{3}. \quad (10)$$

3. Заключение

Полученные выше соотношения позволяют сделать оценки основных характеристик параметрона.

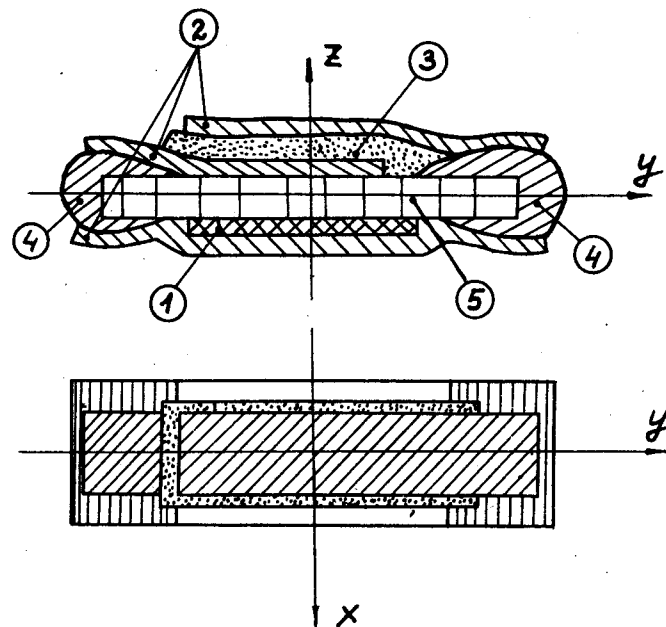
Например, о габаритах параметрона можно судить по следующим данным параметрона, удовлетворяющим формуле (8):

$b'' = 1$ см; $b' = 0,8$ см; $b = 0,8$ см; $a'' = 10^{-2}$ см; $a' = 2 \cdot 10^{-5}$ см; $a = 2,6 \div 2,3 \cdot 10^{-5}$ см; $\epsilon_r = 4$; $M = 6 \cdot 10^3 a \text{ см}^{-1}$; $H_K = 3 a \text{ см}^{-1}$; $\omega = 2\pi \cdot 50 \cdot 10^6 \text{ сек}^{-1}$. Можно принять, например, $c = 2 \cdot 10^{-1}$ см. При этом параметрон будет занимать объем $1 \times 0,2 \times 0,01 \text{ см}^3 = 2 \cdot 10^{-3} \text{ см}^3$.

Для этих условий мощность, выделяющаяся в параметроне, будет $\rho \approx 12 \cdot 10^{-3} \text{ вт}$, при $\varphi_m \approx 0,8$, и $\rho \approx 1,1 \cdot 10^{-3} \text{ вт}$ при $\varphi_m = 0,3$.

Напряжение на емкости будет $u_m \approx 0,8$ при $\varphi_m \approx 0,8$, и $u_m = 0,26$ при $\varphi_m \approx 0,3$.

При этих же условиях емкость конденсатора параметрона будет $c = 2400 \text{ пФ}$.



Р и с.1. Конструкция пленочного параметрона

ЛИТЕРАТУРА

1. Поливанов К.М. Ферромагнетики, Госэнергоиздат, 1957.
2. Стреттон. Теория электромагнетизма, ГИИЛ, 1948.
3. Smith, J.Appl.Phys., 1958, 29, 3.